

前开式晶圆传送盒(FOUP)

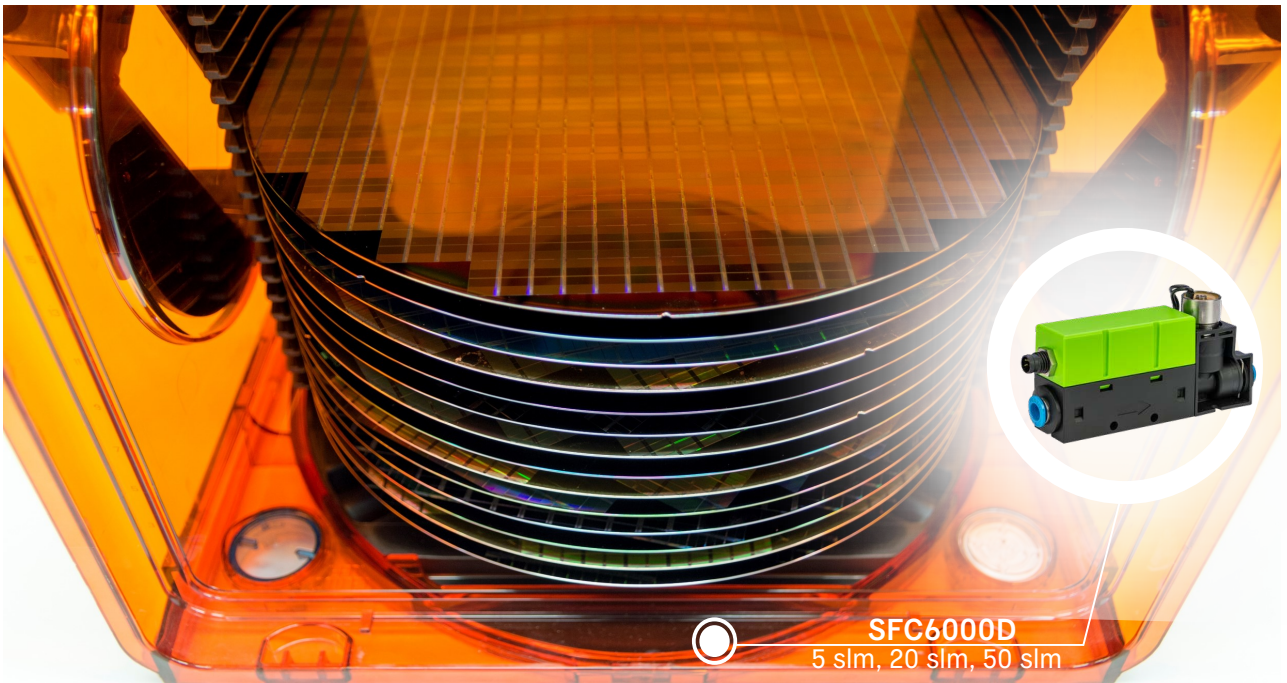
用于晶圆传送盒内的高精度可靠气体扫吹控制

半导体制造过程涉及数百个步骤，耗时长达数月。对集成和存储容量的需求推动了具有极端纵横比的三维微结构的发展。

前开式晶圆传送盒是一种自动化晶片传送载体，主要用于在洁净室中安全地传送晶圆。盛思锐的产品以其高精度和高可重复性而著称。这些产品能够轻松集成至晶圆载体系统中，在确保可靠性和性能的同时减少吹扫气体的用量，从而降低成本。

目标客户:

- 半导体/晶圆传送系统公司



应用挑战

- 1 分配适量的保护性惰性气体
- 2 流量过高可能会损坏高纵横比的结构
- 3 生产过程中的过程控制和产量需要以一致且可重复的方式增加
- 4 降低成本，并优化大批量采购和制造



盛思锐解决方案

- 1 精确、稳定、快速调节吹扫气体
- 2 精确、稳定、快速调节吹扫气体
- 3 CMOSens®技术可提供绝佳的可重复性
- 4 经校准的数字传感器无需额外的微控制器即可驱动阀门

盛思锐传感器解决方案:



SFC6000D 具有卓越性价比的质量流量控制器

Size (LxWxH): 102 x 45 x 20 mm³

传感器其他功能

- 可提供质量流量控制器或质量流量计选项

其他应用

- 分析仪器, 过程控制, 薄膜沉积

FAQs

- 有哪些可用接头?
下装式和推入式
- 有哪些可用的通信接口?
模拟电压、RS485、Modbus RTU和I2C
- 质量流量控制器是否需要定期校准?
不需要。盛思锐的质量流量控制器采用具有出色长期稳定性的CMOS技术, 无需重新校准。
- 质量流量控制器会因受潮损坏吗?
质量流量控制器可在非冷凝的湿度环境中正常工作。
- SFC6000的工作压力范围?
工作压力范围由质量流量控制器的流量范围决定。
5 slm版本的入口和出口之间的最大允许压差为7巴, 20 slm版本为5.5巴, 50 slm版本为4.0巴。无论在任何情况下, 入口的最大允许超压为10巴。

新手入门



EK-F5x

有用文档



数据表、应用说明、操作说明、
示例代码、步骤文件和证书

相关传感器

- SFC54xx mass flow controller
- SFC53xx mass flow controller
- SFM5xxx gas flow sensor
- SFM6xxx gas flow sensors